# 赤外線光弾性装置の開発

本研究では「多結晶シリコン基板の微小歪みの見える化」を実現しました。

## 技術

太陽電池基板は大型化と薄型化が進んで製造工程での割れ対策が重要になっています。割れの要因の一つが基盤中の微小な残留歪みですがその測定は、これまで困難でした。

半導体中の微小な歪みを非破壊で「見える化」できる赤外線光弾性装置 SIRP (Scanning Infrared Polari scope) を開発しました。

- ・SIRP イメージングは歪みの大小と空間的均一性が一目瞭然になり且つ平均値によるロット間比較もできます。
- ・測定に当たって特段の前処理なしに測定が可能です。

### 実用の可能性

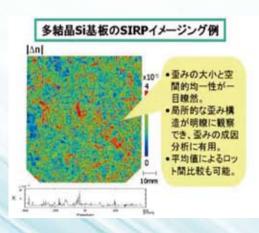
SIRP は独自の赤外光弾性計測技術に基づき、半導体基板中の微小歪みの非接触・非破壊でのイメージングとして多数の世界的研究成果を得ています。

- ・市販多結晶シリコン基板はもちろん薄型基板やリボン結晶にも対応できます。
- ・単結晶シリコンの自重による歪みが測定できる位に 高感度です。
- ・基板に特段の前処理は不要です。

ターゲット	mc-Si, Si, GaAp, InP, SiC, GaN, LiNbO <sub>2</sub> , etc.
最大試料寸法	12インチ(300mm) φ
測定量	Δn, ψ,  Syy-Szzi, 2 Syzi,  Sr-Sti
歪み感度	10-7
空間分解能	100 μ m
測定時間/4インチの 500um)	2 hours

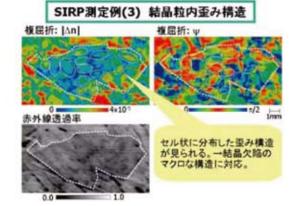
SIRPの仕様

### 技術の裏付



## SIRP拡大図 (1) 直線状粒界拡大 赤外線透過率 複屈折: |Δn| 模屈折: ♥ 0.0 10 10 4410<sup>2</sup> 0 272 サンプル: キャスト紙長 厚を300μm、ウェカルボリッシュ、エッチ海 1mm 粒界に沿った直線状の歪み集中が明瞭に観察できる。

## SIRP拡大図(2) 結晶粒内外 赤外線透過率 模屈折: |Δn| 複屈折: ψ を配折: |Δn| 複屈折: ψ を配析: |Δn| 複屈折: ψ を配析: |Δn| 複屈折: ψ



## 特許関係・参考資料

- ・特願 2006-0999123. WO2007/114305 超音波エコー動画像から組織の周期的な動き(動脈拍動)の強度と位相を抽出・可視化
- ・車間制御用測距センサーに関する研究報告
- ・イメージセンサーに関する研究(丁合機組み込み用 DSP イメージセンサーモジュールの開発) 地域共同研究センター研究成果報告
- ・解説赤外光弾性法を用いた半導体ウエハ・デバイス中のひずみ分布測定

#### 研究者

京都工芸繊維大学 大学院工芸科学研究科 情報工学部門

准教授 福澤 理行

多次元信号の計測と画像化・ 残留歪み・化合物半導体・ 抵抗率・非破壊評価・ 動画像処理・医用画像・ 画像検査

#### 研究テーマ

計測装置など自前で設計・構築するので共同研究も多い。

- ・半導体ウエハの非破壊評価に関する研究
- ・インテリジェントセンサーの開発研究
- ・医用超音波画像処理に関する研究
- ・CT 画像からの心臓 3D 形状抽出に関する研究